

## УРОВНИ ПРИЛИПАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ В $ZnIn_2Se_4$

Мехтиев Н. М., Гусейнов З. З.

Представлены результаты исследования электрических и фотоэлектрических свойств монокристаллов  $ZnIn_2Se_4$  *n*-типа проводимости в интервале температур  $77 \div 300$  К. Обнаружены термостимулированная проводимость, токи, ограниченные объемными зарядами, долговременная релаксация и остаточная проводимость. Установлено, что в запрещенной зоне монокристаллов  $ZnIn_2Se_4$  присутствуют медленные, экспоненциально распределенные в энергетическом интервале  $0.12 \div 0.3$  эВ уровни прилипания для электронов. Определены параметры уровней прилипаний и рекомбинаций в  $ZnIn_2Se_4$ .

Высокая фоточувствительность монокристаллов  $ZnIn_2Se_4$  со структурой тиогаллата делает их одним из весьма перспективных соединений полупроводникового класса  $A^{II}B^{III}C_6$  [1, 2]. На наличие уровней прилипания для основных носителей в этом соединении указано в работах [3-5]. Непосредственные эксперименты для определения природы электронных ловушек в  $ZnIn_2Se_4$  и их количественных параметров не проводились. Представлена работа посвящена этой проблеме, и в ней приводятся результаты исследований электрических и фотоэлектрических свойств  $ZnIn_2Se_4$  в температурном интервале  $77 \div 300$  К. Результаты этих исследований в совокупности с ранее опубликованными данными работ [2, 3] позволяют установить энергетический спектр и основные параметры электронных ловушек в  $ZnIn_2Se_4$ .

Монокристаллы  $ZnIn_2Se_4$  *n*-типа проводимости с удельным сопротивлением  $\rho \sim 10^4$  Ом·см и концентрацией электронов  $\sim 5 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup> при 300 К выращивались газотранспортным методом. Индийевые контакты наносились вакуумным испарением без химических обработок. Расстояние между контактами варьировалось в интервале  $0.15 \div 2$  мм. При исследовании термостимулированных токов (ТСТ) образцы нагревались с постоянными скоростями в интервале  $0.1 \div 1$  К/с и ток регистрировался самописцем КСП-4.

На рис. 1 представлены низкотемпературные (77 К) вольтамперные характеристики (ВАХ) одного из монокристаллов  $ZnIn_2Se_4$  в темноте (кривая 1) и при двух значениях интенсивности возбуждающего света с энергией квантов, большей ширины запрещенной зоны ( $h\nu \geqslant 1.95$  эВ). Как следует из рис. 1, ВАХ кристаллов  $ZnIn_2Se_4$  в общем виде описывается выражением

$$I \sim U^m. \quad (1)$$

В темноте при малых  $U$ , согласно закону Ома, ВАХ линейная ( $m=1$ ). При напряженностях  $\sim 10^2$  В/см наблюдается отклонение от закона Ома и темновой ток с напряжением растет более резко. Начиная с  $E \geqslant 3 \cdot 10^2$  В/см наблюдается очень резкий рост тока. На последнем участке ВАХ значение  $m$  оказывается в интервале 5-7 для разных образцов. Освещение образцов слабым собственным светом (кривая 2) вызывает рождение свободных носителей, и значения тока и напряжения, соответствующие началу нарушения закона Ома, увеличиваются. При этом в области резкого роста тока значение  $m$ , оставаясь всегда меньшим темнового, зависит от интенсивности подсветки (на кривой 2  $m \approx 3.5$ ). При больших значениях интенсивности (кривая 3)  $m$  становится равным 2, т. е. наблюдается квадратичная зависимость тока от напряжения. ВАХ с перечисленными особенностями соответствует протеканию через  $ZnIn_2Se_4$

токов, ограниченных объемными зарядами (ТООЗ) с присутствием экспоненциально распределенных уровней прилипания для инжектированных носителей [6]. Причем показатель  $m > 2$  соответствует заполнению пустых ловушек инжектированными носителями. Из рис. 1 также следует, что в темновой ВАХ  $ZnIn_2Se_4$  участку с  $m > 2$  не предшествует четкая квадратичная зависимость тока от напряжения (ловушечная квадратичная область [8]). Согласно теории ТООЗ [6], это показывает, что уровни прилипания для электронов в  $ZnIn_2Se_4$  расположены в окрестности и ниже равновесного уровня Ферми, и по значению напряжения резкого роста тока нельзя определить концентрацию ловушек. Освещение кристаллов собственным светом вызывает рождение электронно-дырочной пары. При этом дырки захватываются  $n$ -центрами [3] акцепторного

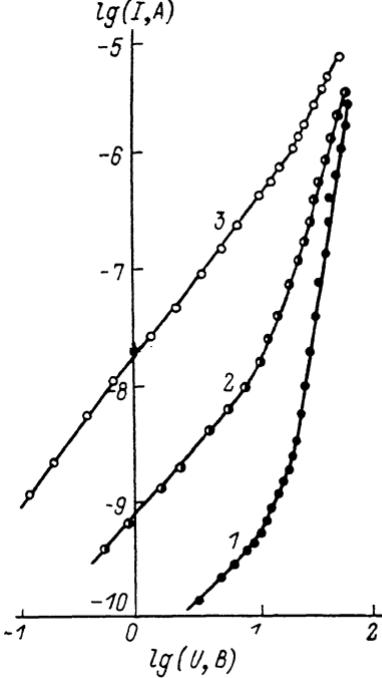


Рис. 1. Вольтамперные характеристики при 77 К в темноте (1) и при освещении собственным светом (2, 3).

типа мгновенно, а электроны — уровнями прилипания. Квазиуровень Ферми движется в сторону свободной зоны, что и приводит к уменьшению значения  $m$ . При высоких интенсивностях подсветки ловушки полностью заполняются и наблюдается безловушечный ТООЗ ( $m=2$ ) [6]. Заметим, что наличие экспоненциально распределенных ловушек у других представителей соединений  $A^{II}B^{III}C^{IV}$  отмечается в [1, 7, 8].

На рис. 2 представлены температурные зависимости темнового и квазitemнового токов в монокристаллах  $ZnIn_2Se_4$ . Как следует из рисунка, зависимость темнового тока от температуры (кривая 1) носит экспоненциальный характер с различными наклонами в области высоких и низких температур. Энергии активации донорных уровней в запрещенной зоне, найденные из рис. 2, оказываются 0.12 и 0.34 эВ от дна зоны проводимости (наши исследования показали, что в области 77–300 К подвижность электронов растет незначительно).

Кривая 2 на рис. 2 соответствует температурной зависимости «квазitemнового» тока. Для получения квазitemнового состояния образцы при 77 К облучаются сильным собственным светом. При отключении света ток через образец в течение 2–3 мин уменьшается экспоненциально с характерным временем  $\tau$  согласно выражению  $i \sim \exp(-t/\tau)$ , где  $\tau \approx 10^2$  с. Дальнейшая релаксация тока не экспоненциальная, т. е. величина  $\tau$  со временем растет. Через ~15 мин на-

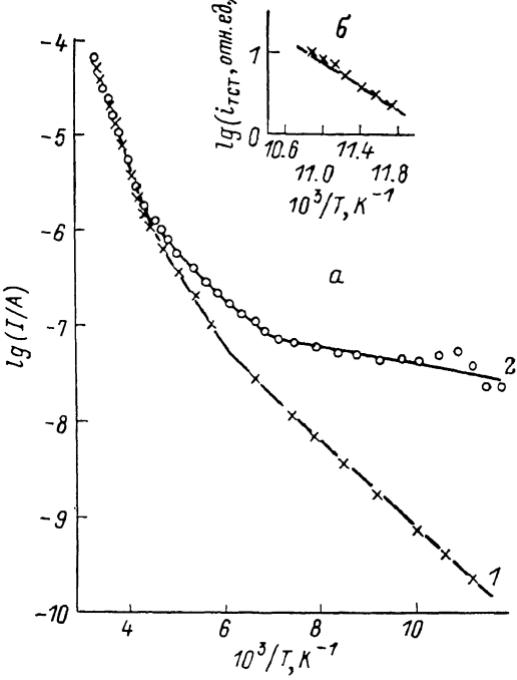


Рис. 2. Температурные зависимости темнового (1) и квазitemнового (2) токов (а), температурная зависимость начального роста ТСТ (б).

блудается квазинасыщение, которое и названо «квазитетновым» состоянием. Характер спада фототока и установление квазитетнового состояния показывают, что для монокристаллов  $ZnIn_2Se_4$  свойственны долговременная релаксация и остаточная проводимость [9], как и в [10]. Величина  $\sigma_{on}/\sigma_r$ , где  $\sigma_r$  и  $\sigma_{on}$  — значения проводимости в темновом и квазитетновом состояниях соответственно, достигает  $10^3 - 10^4$  при 77 К и с ростом  $T$  уменьшается. Из рис. 2 видно, что в квазитетновом состоянии низкотемпературная активация тока не происходит, а при высоких  $T$ , когда эффект остаточной проводимости отсутствует, кривые 1 и 2 сливаются. Отметим, что в [10] остаточная проводимость в  $ZnIn_2Se_4$  объясняется наличием двухзарядных акцепторов в запрещенной зоне, вследствие чего появляются отталкивающие барьеры для электронов высотой  $\sim 20$  мэВ. Измерения кинетики фототока  $ZnIn_2Se_4$  в широкой области изменения интенсивности и температуры показывают, что в процессе рекомбинации участвуют однозарядные акцепторы ( $r$ -центры [3]) с глубиной залегания 0.54 эВ от потолка валентной зоны. Зарядовое состояние акцепторов установлено опре-

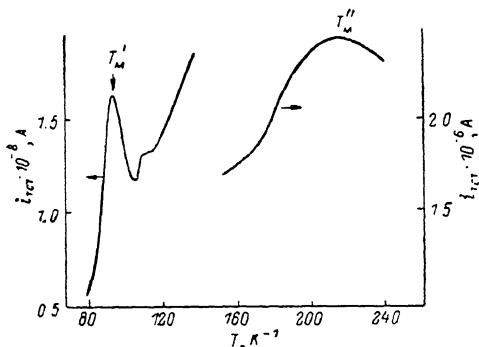


Рис. 3. Температурная зависимость ТСТ.

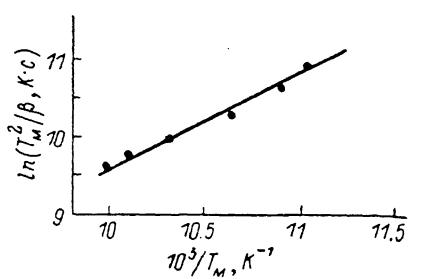


Рис. 4. Зависимость  $T_m^2$  от скорости нагрева.

делением сечения захвата электронов и дырок  $r$ -центраторами, которые оказались  $S_{nr} \approx 5 \cdot 10^{-19}$  и  $S_{pr} \approx 10^{-15}$  см<sup>2</sup>. Такие значения  $S_{pr}$  и  $S_{nr}$  реализуются обычно при однозарядном кулоновском захвате дырок и нейтральными центрами — электронов [11]. Что касается природы оптической памяти, нам кажется, что, как и в большинстве материалов [9], в  $ZnIn_2Se_4$  она обусловлена наличием макроскопических неоднородностей в виде рекомбинационных барьеров высотой  $\sim 0.1$  эВ из-за неоднородного распределения  $r$ -центров. Оценка высоты барьера  $\varphi$  проведена, согласно [9], по формуле  $\tau = \tau_0 \exp(\varphi/kT)$ , где  $k$  — постоянная Больцмана.

На рис. 3 приведена температурная зависимость ТСТ в  $ZnIn_2Se_4$  при скорости нагрева  $\sim 0.35$  К/с. Как следует из рисунка, кривая ТСТ имеет два пика ( $T_m'$  и  $T_m''$ ) при температурах, где наблюдаются низкотемпературная и высокотемпературная активации темнового тока (рис. 1). В областях  $T$ , соответствующих второму пику ТСТ, одновременно происходит и термическое гашение остаточной проводимости. С учетом того, что последний процесс довольно инерционный и происходит в широкой области температур, анализ высокотемпературного пика затруднен, и определить тип и характеристические параметры глубоких ловушек не удалось, оценена лишь приближенным методом [12] глубина залегания, которая оказалась  $\Delta E_1 \approx 0.3$  эВ.

Низкотемпературный пик ТСТ достаточно чувствителен к скорости нагрева и значению приложенного поля. На рис. 4 представлена зависимость значений  $T_m^2$  от скорости нагрева в масштабах  $T_m^2/\beta \sim 10^3/T$ , где  $\beta$  — скорость нагрева. Прямолинейная зависимость показывает, что в кристаллах  $ZnIn_2Se_4$  реализуется случай медленного повторного захвата и проводимость имеет максимум при выполнении условия [12]

$$\frac{\Delta E_2}{kT_m} = \ln\left(\frac{T_m^2}{\beta}\right) + \ln\left(\frac{N_e S v k}{\Delta E_2}\right), \quad (2)$$

где  $\Delta E_2$  — глубина залегания,  $S$  — сечения захвата,  $v$  — тепловая скорость. С другой стороны, линейная зависимость  $T^2/3 \sim 10^3/T$  показывает, что сечение захвата электронов пропорционально  $T^{-2}$  и второй член в правой части (2) является не зависящим от температуры. Тогда наклон прямой на рис. 4 определяет  $\Delta E_2$ , а точка ее пересечения с осью абсцисс позволяет оценить величину сечения захвата. Проведенные расчеты показывают, что для  $ZnIn_2Se_4$  эти параметры оказываются  $\Delta E_2 = 0.12$  эВ,  $S \approx 10^{-18}$  см $^2$ . Из теории ТСТ [12] следует, что независимо от природы центра прилипания наиболее достоверным результатом для определения  $\Delta E$  является измерение температурной зависимости начального роста ТСТ. Для низкотемпературного пика она представлена на рис. 2, б и дает  $\Delta E_2 \approx 0.13$  эВ, что удовлетворительно согласуется с вышеуказанным.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Георгобиани А. Н., Радауцан С. И., Тигиняну И. М. — ФТП, 1985, т. 19, в. 2, с. 193—212.
- [2] Мехтиев Н. М., Гусейнов З. З., Салаев Э. Ю. — ФТП, 1984, т. 18, в. 6, с. 1088—1090.
- [3] Мехтиев Н. М., Гусейнов З. З., Салаев Э. Ю. — Изв. АН АзССР, сер. физ.-тех. и мат. наук, 1984, № 6, с. 72—75.
- [4] Manca P., Raga F., Spiga A. — Nuovo Cimento, 1974, v. 19B, N 1, p. 15—28.
- [5] Grilli E., Guzzi M., Molteni R. — Phys. St. Sol. (a), 1976, v. 37, N 1, p. 399—406.
- [6] Ламперт М., Марк П. Инжекционные токи в твердых телах. М., 1973. 416 с.
- [7] Мехтиев Н. М., Гусейнов З. З. — Изв. АН АзССР, сер. физ.-тех. и мат. наук, 1986, № 3, с. 72—76.
- [8] Guzzi M., Grilli E., Materials. — Chem. Phys., 1984, v. 11, N 3, p. 295—304.
- [9] Шейнкман М. К., Шик А. Я. — ФТП, 1976, т. 10, в. 2, с. 209—233.
- [10] Filippowicz J., Romeo N., Tarricone L. — Sol. St. Commun., 1980, v. 38, N 10, p. 619—623.
- [11] Лашкарев В. Е., Любченко А. В., Шейнкман М. К. Неравновесные процессы в фотопроводниках. Киев, 1981. 264 с.
- [12] Милис А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. М., 1977. 562 с.

Институт физики АН АзССР  
Баку

Получена 19.01.1987  
Принята к печати 2.11.1987

**Микроэлектроника: учебн. пособие для втузов / Под ред. Л. А. Коледова. Кн. 5. Контроль качества и надежность интегральных микросхем. М.: Высшая школа, 1987. 144 с.**

Книга посвящена вопросам надежности полупроводниковых интегральных микросхем (ИМС). Представлены основные понятия теории качества и надежности; описаны эксплуатационные воздействия и требования к надежности ИМС и виды испытаний ИМС. Изложены методы и средства контроля механических и электрических параметров структур после каждой из основных операций приготовления кристаллов, таких как эпитаксия, фотолитография, металлизация и т. д. Освещены контроль гибридных ИМС и микросборок (МСБ), тестовый контроль БИС и МСБ, измерение параметров и контроль функционирования ИМС, оценка качества ИМС по контрольным испытаниям. Обсуждаются расчет надежности ИМС, в том числе по внезапным и постоянным отказам, а также тестовые оценки надежности ИМС и оценки по результатам испытаний. Данна полная программа анализа отказов МДП—БИС. Рассмотрены основные виды и причины отказов ИМС и пути повышения качества и надежности.